Hiroo etal

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-239840

(43)公開日 平成10年(1998) 9月11日

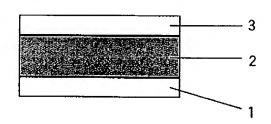
(51) Int.Cl. ⁸	識別記号		FΙ				
G03F 7/027	5 1 3		G03F	7/027		5 1 3	
B 3 2 B 27/40			B32B 2	27/40			
C08F 2/48			C08F	2/48			
290/06			29	90/06			
C 0 9 D 175/16			C 0 9 D 17	75/16			
		審查請求	未請求請求以	頁の数5	OL	(全 14 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特願平9-47801		(71)出願人	000000	033		
				旭化成	工業株	式会社	
(22)出願日	平成9年(1997)3月3日			大阪府	大阪市	北区堂島浜1	丁目2番6号
			(72)発明者	富田	宏朗		
						鮫島2番地の	1 旭化成工業
				株式会	社内		
			(72)発明者	木下	泰彦		
						鮫島2番地の	1 旭化成工業
				株式会	社内		

(54) 【発明の名称】 サンドプラスト用感光性樹脂組成物及びその用途

(57)【要約】

【課題】 ガラス、低融点ガラス、セラミック等の被加工基材に適用する際に感度、解像度、現像性、密着性に優れ、サンドブラスト用のマスク材として被加工基材に微細なパターンを歩留まりよく加工できる材料及び加工方法を提供する。

【解決手段】 末端に水酸基を有するポリマーと、特定のポリイソシアネートと、活性水素を有する官能基とエチレン性不飽和結合を同時に有する化合物より得られるポリウレタンプレポリマーと、アルカリ可溶性高分子と、エチレン性不飽和付加重合性モノマーと、光重合開始剤を含有することを特徴とする感光性樹脂組成物、及び支持体、前記感光性樹脂組成物、保護層を順次積層してなる感光性樹脂積層体を作製する。



る。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (i)末端に水酸基を有するポリマー、 下記一般式(1)で示されるポリイソシアネート、

(式中、R1~R4は水素又はアルキル基)及び活性水 素を有する官能基とエチレン性不飽和結合を同時に有す 10 る化合物より得られるポリウレタンプレポリマー、(i i)アルカリ可溶性高分子化合物、(iii)エチレン 性不飽和付加重合性モノマー、及び(iv)光重合開始 剤を含有することを特徴とするサンドブラスト用感光性 樹脂組成物。

【請求項2】 支持体(A)上に、請求項1記載のサン ドブラスト用感光性樹脂組成物からなる感光性樹脂層 (B)を有するサンドブラスト用感光性樹脂積層体。

【請求項3】 被加工基材上に請求項1記載のサンドブ ラスト用感光性樹脂組成物からなる感光性樹脂層を形成 20 し、露光工程、現像工程によりレジストパターンを形成 した後、サンドブラスト処理を行うことを特徴とする表 面加工方法。

【請求項4】 被加工基材上に請求項2記載のサンドブ ラスト用感光性樹脂積層体を用いて感光性樹脂層を形成 し、露光工程、現像工程によりレジストパターンを形成 した後、サンドブラスト処理を行うことを特徴とする表 面加工方法。

【請求項5】 被加工基材がプラズマディスプレイパネ ルである、請求項3又は請求項4記載の表面加工方法。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はサンドブラスト用感 光性樹脂組成物に関し、更に詳しくはガラス、低融点ガ ラス、セラミック等の被加工基材に適用する際に感度、 解像度、現像性、密着性に優れ、サンドブラスト用のマ スク材として被加工基材に微細なパターンを歩留まりよ く加工できる感光性樹脂組成物、及びそれを用いた感光 性樹脂積層体、及びそれを用いた表面加工方法に関す る。

[0002]

【従来の技術】従来、ガラス、セラミック、陶磁器、石 材、合成樹脂、金属、皮革等被加工基材の表面にサンド ブラストにより凹凸のパターンを加工する際に、感光性 樹脂組成物がマスク材として使用されている。このよう なサンドブラスト用のマスク材として用いられる感光性 樹脂組成物としては、例えば、特開昭55-10355 4号公報に開示されている不飽和ポリエステルと不飽和 モノマー及び光重合開始剤からなる感光性樹脂組成物

端にアクリレート基またはメタクリレート基を持つウレ タンプレポリマーと不飽和モノマー及び光重合開始剤か らなる感光性樹脂組成物、特開平2-69754号公報 に開示されているポリビニルアルコールとジアゾ樹脂か らなる感光性樹脂組成物、特開平6-161097号公 報、特開平6-161098号公報に開示されている末 端にエチレン性不飽和二重結合を有するウレタンオリゴ マー、セルロース誘導体若しくはエチレン性不飽和二重 結合含有化合物、光重合開始剤を含む感光性樹脂組成 物、特開平8-54734号公報に開示されているカル ボキシ変性ウレタン (メタ) アクリレート化合物、アル カリ可溶性高分子化合物と光重合開始剤からなる感光性 樹脂組成物、及び特開平8-305017号公報に開示

されている末端にアクリレート又はメタクリレート基を

持つウレタン化合物とアルカリ可溶性高分子化合物と光

重合開始剤からなる感光性樹脂組成物などが挙げられ

【0003】ところで、近年フォトリソグラフィー技術 及びサンドブラスト技術の進歩に伴い、ガラスやセラミ ックを300μmピッチ以下の微細なパターンに加工するこ とが可能になってきた。例えば特公平7-22893号 公報にはサンドブラスト装置を用いて微細な低融点ガラ スのパターンを形成する方法が開示されている。このよ うなサンドブラストによる微細パターン加工においてマ スク材としての感光性樹脂組成物に要求される性能も多 様かつ高度なものになってきている。

【0004】すなわち、サンドブラスト用マスク材とし ての感光性樹脂組成物に要求される性能としては、300 μmピッチ以下のレジストパターンが低露光量で形成可 能となるよう高感度・高解像度であること、現像時にレ ジストパターンが被加工基材から剥がれないよう密着性 に優れること、サンドブラスト時に研磨材によるダメー ジを受けずに被加工基材を微細なパターンに加工できる よう耐サンドブラスト性を有すること等が要求されてい る。また、被加工基材がガラスや低融点ガラスの場合に は、アルカリによるダメージをできる限り低減する為、 現像時間や剥離時間をできる限り短くすることが求めら れている。

【0005】しかしながら、前述した従来の感光性樹脂 組成物では感度が低く、レジストパターンの形成に多大 な露光量を要したり、現像性が悪く微細なレジストパタ ーンを解像するのが困難であったり、或いは解像するの に多大な現像時間を要したり、現像時に被加工基材との 密着性が低い為にレジストパターンが剥がれてしまった り、サンドブラスト時にレジストラインが欠けたり磨耗 したりチッピングを起こして剥がれてしまう等の問題が あった。特に被加工基材に加工するパターンピッチが狭 まる程上記の問題は顕著に見られるようになり、上記の 要求性能を満足し、被加工基材を微細なパターンに歩留 や、特開昭60-20861号公報に開示されている末 50 まりよく加工できる感光性樹脂組成物が望まれていた。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、上述の問題点を解消し、ガラス、低融点ガラス、セラミック等の被加工基材に適用する際に感度、解像度、現像性、密着性に優れ、サンドブラスト用のマスク材として被加工基材に微細なパターンを歩留まりよく加工できる感光性樹脂組成物、及びそれを用いた感光性樹脂積層体及びそれを用いた表面加工方法を提供することにある。

[0007]

【課題を解決する為の手段】本発明者らは上記課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、特定のウレタンプレポリマーを含有する感光性樹脂組成物及びそれを用いた感光性樹脂積層体を用いることにより上述した課題を解決しうることを見出した。すなわち、本願の第1発明は、

- (i) 末端に水酸基を有するポリマー、下記一般式
- (I) で示されるポリイソシアネート、

[0008]

【化2】

【0009】(式中、R1~R4は水素又はアルキル基)及び活性水素を有する官能基とエチレン性不飽和結合を同時に有する化合物より得られるポリウレタンプレポリマー、(ii)アルカリ可溶性高分子化合物、(ii)エチレン性不飽和付加重合性モノマー、及び(iv)光重合開始剤を含有することを特徴とするサンドブラスト用感光性樹脂組成物である。

【0010】本願の第2発明は、支持体(A)上に、第1発明のサンドブラスト用感光性樹脂組成物からなる感光性樹脂層(B)を有するサンドブラスト用感光性樹脂積層体である。また、この感光性樹脂積層体において、必要に応じ、感光性樹脂層(B)上に保護層(C)を設けることもできる。

【0011】本願の第3発明は、被加工基材上に第1発明のサンドブラスト用感光性樹脂組成物からなる感光性樹脂層を形成し、露光工程、現像工程によりレジストパターンを形成した後、サンドブラスト処理を行うことを40特徴とする表面加工方法である。本願の第4発明は、被加工基材上に第2発明のサンドブラスト用感光性樹脂積層体を用いて感光性樹脂層を形成し、露光工程、現像工程によりレジストパターンを形成した後、サンドブラスト処理を行うことを特徴とする表面加工方法。

【0012】本願の第5発明は、被加工基材がプラズマ いと露光 ディスプレイパネルである、上記第3発明または第4発 ト性及ひ 明の表面加工方法。以下、本発明を詳細に説明する。本 平均分子 発明の(i)成分のポリウレタンプレポリマーは、末端 はGPC に水酸基を有するポリマーとポリイソシアネートから誘 50 である。

導されたポリウレタンの末端イソシアネート基に対して、活性水素を有する官能基とエチレン性不飽和結合を同時に有する化合物を反応させることによって得られる。

【0013】末端に水酸基を有するポリマーとしては、 ポリエステルポリオールやポリエーテルポリオールなど のポリオールや、末端水酸基を有する1、4ーポリブタ ジエン、水添または非水添1、2-ポリブタジエン、ブ タジエンースチレン共重合体、ブタジエンーアクリロニ トリル共重合体等が挙げられる。本発明で用いられる、 ポリイソシアネートは前記一般式(I)で示される化合 物である。式中のR1~R4は水素又はアルキル基であ る。このようなポリイソシアネートとしては、O-キシ リレンジイソシアネート、m-キシリレンジイソシアネ ート、p-キシリレンジイソシアネート、α-メチル-Ο-キシリレンジイソシアネート、α-メチル-m-キ シリレンジイソシアネート、α-メチル-p-キシリレ ンジイソシアネート、 α 、 α ' -ジメチル-O-キシリ レンジイソシアネート、 α 、 α ' -ジメチル-m-キシ シリレンジイソシアネート、α、α、α'ートリメチル -O-キシリレンジイソシアネート、 α 、 α 、 α ' -ト リメチル-m-キシリレンジイソシアネート、 α 、 α 、 α' - γ イソシアネート、 α 、 α 、 α '、 α ' ーテトラメチルー mーキシリレンジイソシアネート、 α 、 α 、 α '、 α ' ーテトラメチルーpーキシリレンジイソシアネートなど が挙げられる。

0 【0014】活性水素を有する官能基とエチレン性不飽和結合を同時に有する化合物としては、ヒドロキシメチル(メタ)アクリレート、2-ヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、2-ヒドロキシプロピル(メタ)アクリレート、ポリエチレングリコールモノ(メタ)アクリレート、ポリプロピレングリコールモノ(メタ)アクリレートなどが挙げられる。

【0015】(i)成分のポリウレタンプレポリマーのエチレン性不飽和結合濃度は、 $2\times10^{-4}\sim10^{-2}$ mol/gが好ましい。 2×10^{-4} mol/g未満では十分に架橋せず耐サンドブラスト性の著しい低下を招き、 10^{-2} mol/gを越えると硬化膜が硬くなり過ぎて耐サンドブラスト性が悪化する。(i)成分のポリウレタンプレポリマーの数平均分子量は $1,500\sim50,00$ のが好ましい。数平均分子量が1,500未満の場合耐サンドブラスト性が低下するし、50,000より大きいと露光後の現像性が著しく低下する。耐サンドブラスト性及び現像性の点から $2,000\sim30,000$ の数平均分子量がより好ましい。ここでいう数平均分子量とはGPC法によるポリスチレン換算数平均分子量のことである。

【0016】(i)成分のポリウレタンプレポリマーの 含有量は感光性樹脂組成物の全重量基準で10~70重 量%、好ましくは20~65重量%、より好ましくは2 5~60重量%である。この量が10重量%未満である と十分な耐サンドブラスト性が得られないし、70重量 %を越えると十分に架橋せず耐サンドブラスト性が低下 すると共に感度が著しく低下する。

【0017】(i)成分のポリウレタンプレポリマーは それぞれ単独で用いてもよいし、2種以上を組み合わせ て用いてもよい。本発明の(ii)成分のアルカリ可溶 10 性高分子化合物としてはカルボン酸含有ビニル共重合体 やカルボン酸含有セルロース等が挙げられる。カルボン 酸含有ビニル共重合体とはα、β-不飽和カルボン酸の 中から選ばれる少なくとも1種の第1単量体と、アルキ ル (メタ) アクリレート、ヒドロキシアルキル (メタ) アクリレート、(メタ)アクリルアミドとその窒素上の 水素をアルキル基またはアルコキシ基に置換した化合 物、スチレン及びスチレン誘導体、(メタ)アクリロニ トリル、及び(メタ)アクリル酸グリシジルの中から選 ばれる少なくとも1種の第2単量体をビニル共重合して 20 得られる化合物である。

【0018】カルボン酸含有ビニル共重合体に用いられ る第1単量体としては、アクリル酸、メタクリル酸、フ マル酸、ケイ皮酸、クロトン酸、イタコン酸、マレイン 酸半エステル等が挙げられ、それぞれ単独で用いてもよ いし2種以上を組み合わせてもよい。カルボン酸含有ビ ニル共重合体における第1単量体の割合は、15~40 重量%、好ましくは20~35重量%である。その割合 が15重量%未満であるとアルカリ水溶液による現像が 困難になる。その割合が40重量%を越えると、重合中 30 に溶媒に不溶となる為合成が困難になる。

【0019】カルボン酸含有ビニル共重合体に用いられ る第2単量体としては、メチル (メタ) アクリレート、 エチル(メタ)アクリレート、n-プロピル (メタ) ア クリレート、シクロヘキシル (メタ) アクリレート、n ーブチル (メタ) アクリレート、2-エチルヘキシル (メタ) アクリレート、2-ヒドロキシエチル (メタ) アクリレート、2-ヒドロキシプロピル (メタ) アクリ レート、4-ヒドロキシブチル (メタ) アクリレート、 ポリエチレングリコールモノ (メタ) アクリレート、ポ 40 リプロピレングリコールモノ (メタ) アクリレート、 (メタ) アクリルアミド、N-メチロールアクリルアミ ド、N-ブトキシメチルアクリルアミド、スチレン、α ーメチルスチレン、pーメチルスチレン、pークロロス チレン、(メタ) アクリロニトリル、(メタ) アクリル 酸グリシジル等が挙げられ、それぞれ単独で用いてもよ いし、2種以上を組み合わせて用いてもよい。カルボン 酸含有ビニル共重合体における第2単量体の割合は、6 0~85重量%、好ましくは65~80重量%である。

分子量は、2万~30万の範囲であり、好ましくは3万 ~15万である。この場合の重量平均分子量とはGPC 法によるポリスチレン換算重量平均分子量のことであ る。この重量平均分子量が2万未満であると、硬化膜の 強度が小さくなる。この重量平均分子量が30万を越え ると、感光性樹脂組成物の粘度が高くなりすぎ塗工性が 低下する。

【0021】カルボン酸含有セルロースとしては、セル ロースアセテートフタレート、ヒドロキシエチル・カル ボキシメチルセルロース等が挙げられる。(ii)成分 のアルカリ可溶性高分子の含有量は感光性樹脂組成物の 全重量基準で10~70重量%、好ましくは20~65 重量%、より好ましくは25~60重量%である。この 量が10重量%未満であると、アルカリ現像液に対する 分散性が低下し現像時間が著しく長くなる。この量が7 ○重量%を越えると、感光性樹脂層の光硬化が不十分と なり、耐サンドブラスト性が低下する。

【0022】本発明の(i i i)成分の、エチレン性不 飽和付加重合性モノマーとしては、公知の種類の化合物 を使用できる。例えば、2-ヒドロキシー3-フェノキ シプロピルアクリレート、フェノキシテトラエチレング リコールアクリレート、β-ヒドロキシプロピル-β' 一(アクリロイルオキシ)プロピルフタレート、1、4 ーテトラメチレングリコールジ (メタ) アクリレート、 1,6-ヘキサンジオールジ (メタ) アクリレート、 1,4-シクロヘキサンジオールジ(メタ)アクリレー ト、オクタプロピレングリコールジ (メタ) アクリレー ト、グリセロール (メタ) アクリレート、2-ジ(p-ヒドロキシフェニル) プロパンジ (メタ) アクリレー ト、グリセロールトリ (メタ) アクリレート、トリメチ ロールプロパントリ (メタ) アクリレート、ポリオキシ プロピルトリメチロールプロパントリ (メタ) アクリレ ート、ポリオキシエチルトリメチロールプロパントリ (メタ) アクリレート、ジペンタエリスリトールペンタ (メタ) アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ (メタ) アクリレート、トリメチロールプロパントリグ リシジルエーテルトリ (メタ) アクリレート、ビスフェ ノールAジグリシジルエーテルジ (メタ) アクリレー ト、ジアリルフタレート、ポリエチレングリコールジ (メタ) アクリレート、ポリプロピレングリコールジ (メタ) アクリレート、4-ノルマルオクチルフェノキ シペンタプロピレングリコールアクリレート、ビス(ト リエチレングリコールメタクリレート) ノナプロピレン グリコール、ビス (テトラエチレングリコールメタクリ レート) ポリプロピレングリコール、ビス (トリエチレ ングリコールメタクリレート) ポリプロピレングリコー ル、ビス(ジエチレングリコールアクリレート)ポリプ ロピレングリコール、4ーノルマルオクチルフェノキシ ペンタエチレングリコールトリプロピレングリコールア 【0020】カルボン酸含有ビニル共重合体の重量平均 50 クリレート、フェノキシテトラプロピレングリコールテ

5-ジフェニルイミダゾリル二量体とミヒラーズケトン若しくは4,4'-(ジエチルアミノ)ベンゾフェノンの組み合わせが好ましい。

トラエチレングリコールアクリレート、ビスフェノール A系(メタ)アクリル酸エステルモノマーの分子中にエチレンオキシド鎖とプロピレンオキシド鎖の双方を含む 化合物などが挙げられる。また、ヘキサメチレンジイソシアネート、トルイレンジイソシアネートなどの多価イソシアネート化合物と、2ーヒドロキシプロピル(メタ)アクリレートなどのヒドロキシアクリレート化合物とのウレタン化化合物なども用いることができる。この場合のウレタン化化合物はGPCによるポリスチレン換算数平均分子量で1,500未満のものである。これら 10のエチレン性不飽和付加重合性モノマーはそれぞれ単独で用いてもよいし2種以上を組み合わせて用いてもよい。

【0025】(iv)成分の光重合開始剤の含有量は感光性樹脂組成物の全重量基準で0.01~20重量%、好ましくは1~10重量%含まれる。この量が0.01%より少ないと感度が十分でない。またこの量が20重量%より多いと紫外線吸収率が高くなり、感光性樹脂層の底の部分の硬化が不十分になる。感光性樹脂組成物の熱安定性、保存安定性を向上させる為に本発明の感光性樹脂組成物にラジカル重合禁止剤を含有させることは好ましい。このようなラジカル重合禁止剤としては、例えばアーメトキシフェノール、ハイドロキノン、ピロガロール、ナフチルアミン、tーブチルカテコール、塩化第一銅、2,6ージーtーブチルーpークレゾール、2,2′メチレンビス(4ーエチルー6ーtーブチルフェノール)、2,2′ーメチレンビス(4ーメチルー6ーtーブチルフェノール)等が挙げられる。

【0023】(iii)成分のエチレン性不飽和付加重合性モノマーの含有量は感光性樹脂組成物の全重量基準で5~40重量%、好ましくは10~35重量%である。その割合が5重量%未満であると十分に架橋せず耐サンドブラスト性が低下する。その割合が40重量%を越えると硬化膜が硬くなりすぎて耐サンドブラスト性が低下する。

【0026】本発明の感光性樹脂組成物には染料、顔料20 等の着色物質が含有されていてもよい。このような着色物質としては、例えばフクシン、フタロシアニングリーン、オーラミン塩基、カルコキシドグリーンS、パラマジェンタ、クリスタルバイオレット、メチルオレンジ、ナイルブルー2B、ビクトリアブルー、マラカイトグリーン、ベイシックブルー20、ダイヤモンドグリーン等が挙げられる。

【OO24】本発明の(iv)成分の、光重合開始剤と しては、ベンジルジメチルケタール、ベンジルジエチル ケタール、ベンジルジプロピルケタール、ベンジルジフ ェニルケタール、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾイ ンエチルエーテル、ベンゾインプロピルエーテル、ベン ゾインフェニルエーテル、チオキサントン、2,4-ジ メチルチオキサントン、2,4-ジエチルチオキサント ン、2-イソプロピルチオキサントン、4-イソプロピ ルチオキサントン、2,4-ジイソプロピルチオキサン トン、2-フルオロチオキサントン、4-フルオロチオ 30 キサントン、2-クロロチオキサントン、4-クロロチ オキサントン、1-クロロ-4-プロポキシチオキサン トン、ベンゾフェノン、4,4'-ビス(ジメチルアミ ノ)ベンゾフェノン[ミヒラーズケトン]、4,4'ー ビス (ジエチルアミノ) ベンゾフェノン、2、2ージメ トキシー2ーフェニルアセトフェノンなどの芳香族ケト ン類、2-(o-2)ロロフェニル)-4, 5-ジフェニルイミダゾリル二量体等のビイミダゾール化合物、9-フェニルアクリジン等のアクリジン類、 α 、 α -ジメト キシーαーモルホリノーメチルチオフェニルアセトフェ 40 ノン、2、4、6-トリメチルベンゾイルジフェニルホ スフィンオキシド、フェニルグリシン、さらに1-フェ ニルー1,2-プロパンジオン-2-o-ベンゾイルオ キシム、2,3-ジオキソ-3-フェニルプロピオン酸 エチルー2-(o-ベンゾイルカルボニル)-オキシム 等のオキシムエステル類、pージメチルアミノ安息香 酸、pージエチルアミノ安息香酸及びpージイソプロピ ルアミノ安息香酸及びこれらのアルコールとのエステル 化物、pーヒドロキシ安息香酸エステルなどが挙げられ

る。その中でも特に2-(o-クロロフェニル)-4、

【0027】また、本発明の感光性樹脂組成物に光照射 により発色する発色系染料を含有させてもよい。このよ うな発色系染料としては、ロイコ染料とハロゲン化合物 の組み合わせが良く知られている。ロイコ染料として は、例えばトリス(4ージメチルアミノー2ーメチルフ ェニル) メタン [ロイコクリスタルバイオレット]、ト リス (4-ジメチルアミノ-2-メチルフェニル) メタ ン[ロイコマラカイトグリーン]等が挙げられる。一方 ハロゲン化合物としては臭化アミル、臭化イソアミル、 臭化イソブチレン、臭化エチレン、臭化ジフェニルメチ ル、臭化ベンザル、臭化メチレン、トリブロモメチルフ ェニルスルホン、四臭化炭素、トリス(2,3ージブロ モプロピル) ホスフェート、トリクロロアセトアミド、 ヨウ化アミル、ヨウ化イソブチル、1,1,1ートリク ロロー2, 2ービス (pークロロフェニル) エタン、へ キサクロロエタン等が挙げられる。

【0028】さらに本発明の感光性樹脂組成物には、必要に応じて可塑剤等の添加剤を含有させてもよい。このような添加剤としては、例えばジエチルフタレート等のフタル酸エステル類、oートルエンスルホン酸アミド、pートルエンスルホン酸アミド、クエン酸トリブチル、クエン酸トリエチル、アセチルクエン酸トリエチル、アセチルクエン酸トリーnープロピル、アセチルクエン酸50トリーnーブチル、ポリプロピレングリコール等が挙げ

られる。

【0029】本発明の感光性樹脂組成物は、用途目的に応じて、液状のままバーコーター、ロールコーターやスピンコーター等を用いて被加工基材上に塗布し感光性樹脂層を形成したり、支持体(A)上に本発明の感光性樹脂組成物からなる感光性樹脂層(B)、及び必要に応じて保護層(C)を順次積層し感光性樹脂積層体とした後、被加工基材上にラミネートすることによって用いることができる。

【0030】前記感光性樹脂積層体の支持体(A)と は、本発明の感光性樹脂組成物からなる感光性樹脂層を 支持する為のフィルムであり、活性光線を透過させる透 明な材料が好ましい。このような材料としては10~100 μπ厚程度のポリエチレン、ポリプロピレン、ポリカー ボネート、ポリエチレンテレフタレートなどの合成樹脂 フィルムがあるが、、通常適度な可とう性と強度を有す るポリエチレンテレフタレートが好ましく用いられる。 【0031】前記感光性樹脂積層体には必要に応じて保 護層(C)を積層する。感光性樹脂層(B)との密着力 において、感光性樹脂層と支持体との密着力よりも感光 20 性樹脂層と保護層の密着力が充分小さいことがこの保護 層に必要な特性であり、これにより保護層が容易に剥離 できる。このような保護層に用いられるフィルムとして は、例えばポリエチレンフィルム、ポリプロピレンフィ ルム等がある。

【0032】支持体(A)、感光性樹脂層(B)、及び保護層(C)を順次積層して感光性樹脂積層体を作成する方法は、従来知られている方法で行うことができる。例えば感光性樹脂層(B)に用いる感光性樹脂組成物を、これらを溶解する溶剤と混ぜ合わせ均一な溶液にしておき、まず支持体(A)上にバーコーターやロールコーターを用いて塗布して乾燥し、支持体上に感光性樹脂層(B)を積層する。次いで、この感光性樹脂層(B)上に保護層(C)を積層することにより感光性樹脂積層体を作成することができる。

【0033】次に、本発明の感光性樹脂積層体を用いて被加工基材上に微細なパターンを加工する方法の1例について図2を用いて説明する。図1の感光性樹脂積層体の保護層を剥がしながら被加工基材上にホットロールラミネーターを用いて密着させるラミネート工程、所望の 40 微細パターンを有するフォトマスクを支持体上に密着させ活性光線源を用いて露光を施す露光工程、支持体を剥離した後アルカリ現像液を用いて感光性樹脂層の未露光部分を溶解除去、微細なレジストパターンを被加工基材上に形成する現像工程、形成されたレジストパターン上からブラスト材を吹き付け被加工基材を目的の深さに切削するサンドブラスト処理工程、レジストパターンをアルカリ剥離液を用いて被加工基材から除去する剥離工程を経て、被加工基材上に微細なパターンを加工することができる。 50

10

【0034】前記露光工程において用いられる活性光線源としては、高圧水銀灯、超高圧水銀灯、紫外線蛍光灯、カーボンアーク灯、キセノンランプなどが挙げられる。また、より微細なレジストパターンを得るためには平行光光源を用いるのがより好ましい。前記現像工程において用いられるアルカリ現像液としては通常炭酸ナトリウム水溶液や界面活性剤水溶液等が用いられる。

【0035】前記サンドブラスト処理工程に用いるブラスト材は公知のものが用いられ、例えばSiC, SiО 10 2、A 12〇3、Zr〇、ガラス等の2~100μm程度の 微粒子が用いられる。前記剥離工程に用いる剥離液としては通常水酸化ナトリウムや水酸化カリウムの水溶液等が用いられる。なお、剥離工程の代わりに高温でレジストパターンを焼き飛ばす工程を設けることも可能である。

【0036】本発明の感光性樹脂組成物及び感光性樹脂 積層体は電子ディスプレイ、特にプラズマディスプレイ パネルの製造に好適である。

[0037]

【発明の実施の形態】以下、実施例により本発明の実施 の形態をさらに詳しく説明する。また、実施例及び比較 例における評価は次の方法により行った。

(1)現像性

ソーダガラス上に感光性樹脂層を形成し、30℃の1% 炭酸ナトリウム水溶液をスプレーし、未露光の感光性樹脂層が溶解するのに要する最小現像時間を測定した。

【0038】(2)レジストライン密着性

露光の際の露光部と未露光部の幅が1:100の比率の ラインパターンを通して、露光した。最小現像時間の

1.5倍の現像時間で現像し、硬化レジストラインが正常に形成されている最小マスク幅をレジストライン密着性の値とした。この密着性により次の様にランク分けした。

50 μ II以下: ◎

50μmを越え70μm以下: ○

70 mmを越え100 m以下: △

100 μmを越える:×

(3)耐サンドブラスト性

感光性樹脂層にフォトマスク無しで全面露光を施した。)次いでブラスト材吐出ノズルーサンプル間距離を100 mm、研磨剤塗出圧力3kg/cm²に設定し、ブラス ト材にガラスビーズ#200を使用し、サンドブラスト を行った。樹脂層が磨耗して貫通孔が生じるまでの時間 (磨耗時間)を測定した。この磨耗時間により次の様に ランク分けした。

30秒未满:×

30秒以上60秒未満:△

60秒以上:〇

[0039]

50 【実施例1~20、比較例1~30】

(感光性樹脂積層体の作成)表1~表5に示す組成の感光性樹脂組成物を混合し、感光性樹脂組成物の溶液を厚さ20μmのポリエチレンテレフタレートフィルムにバーコーターを用いて均一に塗布し、90℃の乾燥機中で4分間乾燥して40μm厚みの感光性樹脂組成物層を形成した。次に、感光性樹脂層の表面上に30μm厚みのポリエチレンフィルムを張り合わせて感光性樹脂積層体を得た。

【0040】(被加工基材)サンドブラスト加工に用いる被加工基材はソーダガラス及び以下の方法で作成した 10 ガラスペースト塗工済みソーダガラスの2種類を用いた。ソーダガラス上に、プラズマディスプレイ用ガラスペースト(日本電気硝子社製 PLS-3150)をスクリーン印刷法を用いて、ガラスペーストの乾燥後の厚みが150μmとなるようにソーダガラス上に塗布、乾燥しガラスペースト塗工済みソーダガラスを作成した。【0041】(ラミネート)感光性樹脂積層体のポリエチレンフィルムを剥がしながら、被加工基材にホットロールラミネーター(旭化成工業製「AL-70」)により105℃でラミネートした。エア圧力は3.5kg/ 20 cm²ゲージとし、ラミネート速度は1.0m/min とした。

【0042】(露光)感光性樹脂層にフォトマスク無しあるいは評価に必要なフォトマスクを通して、超高圧水銀ランプ(オーク製作所製HMW-801)により150mJ/cm²で露光した。

(現像)ポリエチレンテレフタレートフィルムを剥離した後、30℃の1%炭酸ナトリウム水溶液を所定時間スプレーし感光性樹脂層の未露光部分を溶解除去した。

【0043】実施例及び比較例の組成と結果を表1~表 30 5 に示す。なお、表1~表5 に示す組成の略号は、以下 に示すものである。

P-1:メタクリル酸/メタクリル酸メチル/アクリロニトリル (重量比が23/52/25)の組成を有し重量平均分子量が13万である共重合体の35%メチルエチルケトン溶液。

【0044】P-2:メタクリル酸/メタクリル酸メチル/スチレン/アクリロニトリル(重量比が30/25/25/20)の組成を有し重量平均分子量が8万である共重合体の35%メチルエチルケトン溶液。

P-3:メタクリル酸/メタクリル酸メチル/アクリル酸n-ブチル(重量比が25/65/10)の組成を有し重量平均分子量が8万である共重合体の29%メチルエチルケトン溶液。

【0045】P-4: メタクリル酸/メタクリル酸メチル/アクリル酸n-ブチル(重量比が20/40/40)の組成を有し重量平均分子量が10万である共重合体の29%メチルエチルケトン溶液。

(ウレタンプレポリマーAの製造)ポリ(エチレングリ 50 ポリマーFを得た。ウレタンプレポリマーFの数平均分

12

コールアジペート)ジオール(水酸基価56.1)20 の重量部と触媒としてジブチル錫ジラウレート(以下B TLと略記する)0.01gを反応容器に入れよく混合 した。そこにmーキシリレンジイソシアネート(以下m XDIと略記する)23.0重量部を添加し、良く撹拌 してから外温を40℃から80℃に昇温し、そのまま約 5時間反応させた後2ーヒドロキシエチルアクリレート (分子量116)を5.8重量部添加しよく撹拌した。 約2時間反応させたところで反応を止め、ウレタンプレ ポリマーAを得た。ウレタンプレポリマーAの数平均分 子量は15,000であった。

【0046】O-2: ウレタンプレポリマーB (ウレタンプレポリマーBの製造) α 、 α 、 α 、 α '、 α ' ーテトラメチルーmーキシリレンジイソシアネート(以下mTMXDIと略記する)30.0重量部を用いた他は、ウレタンプレポリマーAと同様に反応させ、ウレタンプレポリマーBを得た。ウレタンプレポリマーBの数平均分子量は15,000であった。

【0047】O-3:ウレタンプレポリマーC (ウレタンプレポリマーCの製造)イソホロンジイソシアネート(以下IPDIと略記する)27.3重量部を用いた他は、ウレタンプレポリマーAと同様に反応させ、ウレタンプレポリマーCの数平均分子量は15,000であった。

【0048】O-4:ウレタンプレポリマーD (ウレタンプレポリマーDの製造)へキサメチレンジイ ソシアネート(以下HMDIと略記する)20.5重量 部を用いた他は、ウレタンプレポリマーAと同様に反応 させ、ウレタンプレポリマーDを得た。ウレタンプレポ リマーDの数平均分子量は、15,000であった。

【0049】O-5:ウレタンプレポリマーE (ウレタンプレポリマーEの製造)トリレンジイソシアネート(2,4-体/2,6体モル比率4/1、以下T DIと略記する)21.3重量部を用いた他は、ウレタンプレポリマーAと同様に反応させ、ウレタンプレポリマーEを得た。ウレタンプレポリマーEの数平均分子量は15,000であった。

【0050】0-6:ウレタンプレポリマーF (ウレタンプレポリマーFの製造)ポリ(1,4-ブタ 40 ンジオールアジペート)ジオール(水酸基価44.9) 100重量部とポリオキシエチレン(EO)ーオキシプロピレン(PO)ブロック共重合体ジオール(EO/POモル比1/4、水酸基価44.9)100重量部と触媒としてBTL0.01gを反応容器に入れよく混合した。そこにmXDI17.8重量部を添加し、良く撹拌してから外温を40℃から80℃に昇温し、そのまま約5時間反応させた後2ーヒドロキシエチルアクリレート(分子量116)を3.9重量部添加しよく撹拌した。約2時間反応させたところで反応を止め、ウレタンプレ 子量は21,000であった。
【0051】0-7:ウレタンプレボリマーG
(ウレタンプレゼリマーGの製造) mTMYD L

(ウレタンプレポリマーGの製造) mTMXDI23. 2重量部を用いた他は、ウレタンプレポリマーFと同様に反応させ、ウレタンプレポリマーGを得た。ウレタンプレポリマーGの数平均分子量は21,000であった。

【0052】O-8: ウレタンプレポリマーH (ウレタンプレポリマーHの製造) I P D I 21. 1重 量部を用いた他は、ウレタンプレポリマーF と同様に反 10 と触媒としてB T L 0. 01gを反応容器に入れよく混応させ、ウレタンプレポリマーHを得た。ウレタンプレ ポリマーHの数平均分子量は21,000であった。 撹拌してから外温を40℃から80℃に昇温し、そのま

【0053】0-9:ウレタンプレポリマーI

(ウレタンプレポリマーIの製造) HMD I 15.9重量部を用いた他は、ウレタンプレポリマーFと同様に反応させ、ウレタンプレポリマーIを得た。ウレタンプレポリマーIの数平均分子量は21,000であった。

【0054】0-10:ウレタンプレポリマーJ

(ウレタンプレボリマーJの製造) TDI16.4重量 部を用いた他は、ウレタンプレボリマーFと同様に反応 20 させ、ウレタンプレポリマーJを得た。ウレタンプレポリマーJの数平均分子量は21,000であった。

【0055】O-11:ウレタンプレボリマーK (ウレタンプレボリマーKの製造)ボリプロピレングリコール(水酸基価74.8)200重量部と触媒としてBTL0.01gを反応容器に入れよく混合した。そこにmXDI31.3重量部を添加し、良く撹拌してから外温を40℃から80℃に昇温し、そのまま約5時間反応させた後2-ヒドロキシエチルアクリレート(分子量116)を8.5重量部添加しよく撹拌した。約2時間30反応させたところで反応を止め、ウレタンプレボリマーKを得た。ウレタンプレボリマーKの数平均分子量は10,000であった。

【0056】O-12:ウレタンプレポリマーL (ウレタンプレポリマーLの製造)mTMXDI41. 0重量部を用いた他は、ウレタンプレポリマーKと同様 に反応させ、ウレタンプレポリマーLを得た。ウレタン プレポリマーLの数平均分子量は10,000であっ た。

[0057]

○-13:ウレタンプレボリマーM(ウレタンプレボリマーMの製造)IPDI37.2重量部を用いた他は、ウレタンプレボリマーKと同様に反応させ、ウレタンプレボリマーMを得た。ウレタンプレボリマーMの数平均分子量は10,000であった。

【0058】O-14:ウレタンプレポリマーN (ウレタンプレボリマーNの製造) HMDI27.9重量部を用いた他は、ウレタンプレポリマーKと同様に反応させ、ウレタンプレボリマーNを得た。ウレタンプレポリマーNの数平均分子量は10,000であった。

14

【0059】O-15:ウレタンプレポリマーO (ウレタンプレポリマーOの製造) TDI28.9重量 部を用いた他は、ウレタンプレポリマーKと同様に反応 させ、ウレタンプレポリマーOを得た。ウレタンプレポ リマーOの数平均分子量は10,000であった。

【0060】O-16:ウレタンプレポリマーP (ウレタンプレポリマーPの製造)ポリエチレングリコール(水酸基価112.2)150重量部とポリ(1,6-ヘキサンジオールアジペート)ジオール50重量部と触媒としてBTL0.01gを反応容器に入れよく混合した。そこにmXDI46.0重量部を添加し、良く撹拌してから外温を40℃から80℃に昇温し、そのまま約5時間反応させた後2-ヒドロキシエチルメタクリレート(分子量130)を17.5重量部添加しよく撹拌した。約2時間反応させたところで反応を止めウレタンプレポリマーPを得た。ウレタンプレポリマーPの数平均分子量は5,000であった。

【0061】O-17:ウレタンプレボリマーQ (ウレタンプレポリマーQの製造)mTMXDI60. 7重量部を用いた他は、ウレタンプレポリマーPと同様に反応させ、ウレタンプレポリマーQを得た。ウレタンプレポリマーQの数平均分子量は5,000であった。 【0062】O-18:ウレタンプレポリマーR (ウレタンプレポリマーRの製造)IPDI54.9重量部を用いた他は、ウレタンプレポリマーRを得た。ウレタンプレポリマーRをせ、ウレタンプレポリマーRを得た。ウレタンプレボリマーRの数平均分子量は5,000であった。 【0063】O-19:ウレタンプレポリマーS

(ウレタンプレポリマーSの製造) HMD I 4 1. 0重 量部を用いた他は、ウレタンプレポリマーPと同様に反 応させ、ウレタンプレポリマーSを得た。ウレタンプレ ポリマーSの数平均分子量は5,000であった。

【0064】O-20:ウレタンプレポリマーT (ウレタンプレポリマーTの製造) TDI42.5重量 部を用いた他は、ウレタンプレポリマーPと同様に反応 させ、ウレタンプレポリマーTを得た。ウレタンプレポリマーTの数平均分子量は5,000であった。

【0065】M-1: ノナエチレングリコールジアクリレート

40 M-2: ヘキサメチレンジイソシアナートとトリプロピレングリコールモノメタクリレートとのウレタン化物M-3: トリメチロールプロパントリアクリレートM-4: フェノキシヘキサエチレングリコールアクリレート

M-5: 平均8モルのプロピレンオキサイドを付加したポリプロピレングリコールにエチレンオキサイドをさらに両端にそれぞれ平均3モル付加したグリコールのジメタクリレート

I-1:ベンゾフェノン

50 I-2:ベンジルジメチルケタール

16

I-3:ミヒラーズケトン

*D-1:ロイコクリスタルバイオレット

I-4:2-(o-2007ェニル)-4,5-ジフェ D-2:ダイヤモンドグリーン

ニルイミダゾリル二量体

[0066]

I-5:2,4-ジエチルチオキサントン

【表1】

I-6:p-ジメチルアミノ安息香酸エチル

		異應例1	異議例2	比较例1	比較例2	比较例3	実施例3	実施例4	此較例4	比较例5	比较例6
P-1		71.5	71.5	71.5	71.5	71.5	157.2	157.2	157.2	157.2	157.2
0-1		55									
O-2			SS								
0-3				55							
0-4					55						
0-5						55					
0-11							30				
0-12								30			
0-13									30		
0-14										30	
0-15											30
M 1							5	5	5	S	5
M-3		5	5	5	5	5	1	1	1	1	1
M – 5		8	8	8	8	8	4	4	4	4	4
1-1		6	6	6	6	6					
1 – 3		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2					
1-5							1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
1 – 6							3	3	3	3	3
D-1		0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
D – 2		0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0,0\$	0.05	0.05
耐サンドプラスト性	[sec]	O85	O85	O90	O80	O80	070	O70	()70	O65	O65
現像性	[sec]	60	60	70	70	70	60	60	70	70	70
レジストライン密着性*1	[µm]	O70	()70	△80	∆80	△80	060	O60	070	O70	()70
レジストライン密着性*2	[µ m]	○60	Oe0	O70	070	O70	Q50	© 50	O60	O60	O60

[0067]

※ ※【表2】

^{*2:}被加工基材にガラスペースト堕布済みソーダガラスを用いたもの

17

		突悠到5	實施例6	比較例7	比較988	比较到9	突施例7	実施例8	比較例10	比較例11	比较别12
P-1		71.5	71.5	71.5	71.5	71.5					
P – 2							157.2	157.2	157.2	157.2	157,2
0-1							30				
0-2								30			
0 – 3									30		
0-4										30	
O – 5											30
0-16		40									
0+17			40								
0-18				40							
0-19					40						
0-20						40					
M – 1		10	10	10	10	10					
M – 3		10	10	10	10	10					
M – 4							10	10	10	10	10
M- 5		10	10	10	10	10					
1 2		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1 – 3		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
D-1		0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
D - 2		0.05	0,05	0.05	0,05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
耐サンドプラスト性	[sec]	O80	OBO	O80	O75	O75	O75	075	Q80	075	O75
現像性	[sec]	50	50	50	60	60	70	70	80	80	80

レジストライン密着性*2 [μm] ○60 *1:被加工器材にソーダガラスを用いたもの

レジストライン密着性*1 [μm] Q70

O70

○60

△80

O70

△90

∆80

△80

070

O60

Q50

Q60

Q50

070

O60

O70

O60

△80

070

[0068]

* *【表3】

^{*2:}被加工器材にガラスペースト整布済みソーダガラスを用いたもの

20

		奥施例9	実施例10	比較例13	比较例14	比较例15	食施例11	奥施例12	比較例16	比较例17	比較例18
P – 2		85.8	85.8	85.8	85.8	85.8					
P – 3							138	138	138	138	138
0 ~ 6		,					35				
0 – 7								35			
0 – 8									35		
0 – 9										35	
0-10											35
0-11		45									
0-12			45								
0-13				45							
0-14					45						
0-15						45					
M-1		10	10	10	10	10					
M 2		6	6	6	6	6	17	17	. 17	17	17
M-3		4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
t — 2							2	2	2	2	2
1 – 3							0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1-4							2	2	2	2	2
1 – 5		1.2	1,2	1,2	1.2	1.2					
1 – 6		3	3	3	3	3					
D-1		0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
D – 2		0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05 -	0.05	0.05	0.05
耐サンドプラスト性	[sec]	O85	O85	⊜80	O85	O80	O80	⊜80	O80	O80	O75
現像性	[sec]	70	70	80	80	80	50	50	60	60	60
レジストライン伝着性*1	(µm))70	O70	△80	∆80	Δ80	Oe0	○60	O70)70	O70
レジストライン密着性*2	{µm}	O60	O60	070	O70	O70	© 50	O 50	O60	O60	O60

^{*1:}被加工基材にソーダガラスを用いたもの

[0069]

* *【表4】

^{*2:}被加工基材にガラスペースト連布済みソーダガラスを用いたもの

22

		実施例13	实施例14	比較例19	北松門20	比较例21	実施例15	実推例16	比较例22	比较例23	比较例24
P - 3		86.3	86.3	86.3	86,3	86.3					
P-4 .							103.5	103.5	103.5	103.5	103.5
0 - 1							45				
0 - 2			<u> </u>					45			
0 - 3									45		
0 – 4										45	
0 - 5											45
0-11		55									
0-12			55								
0-13				55							
0-14					55						
0-15						55					
M 1							5	5	5	5	S
M - 2		- 11	11	11	11	1)	5	5	5	5	5
M - 3		2	2	2	2	2	3	.3	. 3	3	3
M 4						<u></u>	5	5	5	5	5
I = 1		1	1	1	1	1	3	3	3	3	3
1 – 2		3	3	3	3	3	1	1	1	1	1
I - 3		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1 - 4		2	Z	Z	2	2	2	Z	2	Z	Z
D – 1		0.75	0,75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
0-2		0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
耐サンドプラスト性	[sec	○80	O80	O80	O80	O75	O80	O80	O85	O80	075
现像性	(sec)	50	50	60	60	60	50	So	60	60	60
レジストライン密着性*1	[µm]	O70	O70	△80	∆80	△80	O70	070	∆80	Δ80	Δ80
レジストライン密着性*2	[µm]	Oes	Oes	△75	△75	Δ75	060	O60	O70	O70	O70

^{*1:}独加工器材にソーダガラスを用いたもの

[0070]

^{*2:}被加工基材にガラスペースト造布消みソーダガラスを用いたもの

24

د ب										-	
		実施到17	実施例18	比较例25	比较到26	比较例27	実施到19	実施例20	比较例28	比较例29	比较例30
P = 4		86.3	86.3	86.3	86.3	86.3	189.7	189.7	189.7	189.7	189.7
0-11		40					•				
0-12			40								
0-13				40							
0-14					40						
0-15						40					
0-16							.30				
0-17								30			
0-18									30		
0-19										30	
0-20											30
M-1		10	10	10	10	10					
M-2		10	10	10	10	10					
M - 3		10	10	10	10	10			•		
M - 4							5	5	5	5	5
M - 5							5	5	5	5	5
1 – 1	<u> </u>	1.4	1.4	1,4	1.4	1.4	1,4	1,4	1.4	1.4	1.4
1-2		1	1	1	1	1	1	1	11	1.	1
1-3		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	O.Z	0.2	0.2
1-4		1,5	1,5	1,5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
D-1		0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	Q.75	0.75
D - 2		0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.0\$	Q.05	0.05
耐サンドプラスト性	[sec]	OB0	O80	O75	O80	Q75	O70	O70	()70	O70 ⁻	O65
现像性	[sec]	60	60	70	70	70	60	60	70	70	70
レジストライン密着性*1	[μm]	()70	O70	△80	△80	∆80	Oe0	Oe0	O70	O70	O70
レジストライン密着性*2	[µm]	O60	O60	O70	□70	O70	O 50	O 50	O60	Oe0	OEO

^{*1:}被加工基材にソーダガラスを用いたもの

[0071]

【発明の効果】本発明のサンドブラスト用感光性樹脂組 30 である。 成物及びそれを用いた感光性樹脂積層体は、ガラス、低 融点ガラス、セラミックス等の被加工基材に適用する際 に、感度、解像度、現像性、密着性に優れ、サンドブラ スト用のマスク材として被加工基材に微細なパターンを 歩留まりよく加工できるという効果を有する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の感光性樹脂積層体の1例を示す断面図 である。

【図2】本発明の感光性樹脂積層体を用いて被加工基材*

*上に微細なパターンを加工する方法の1例を示す断面図

1:支持体

2:感光性樹脂層

【符号の説明】

3:剥離フィルム(保護層)

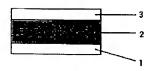
4:被加工基材

5:活性光線

6:フォトマスク

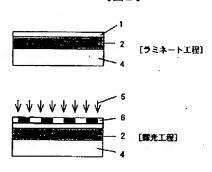
7:感光性樹脂層(光硬化部分)

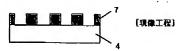
【図1】

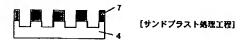


^{*2:}被加工器材にガラスペースト弦布済みソーダガラスを用いたもの

【図2】









フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6		識別記号	FΙ		
G03F	7/004	512	G03F	7/004	512
H01J	9/02		H01J	9/02	F
// B24C	1/04		B 2 4 C	1/04	С